

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成23年5月26日(2011.5.26)

【公表番号】特表2008-539399(P2008-539399A)

【公表日】平成20年11月13日(2008.11.13)

【年通号数】公開・登録公報2008-045

【出願番号】特願2008-508125(P2008-508125)

【国際特許分類】

G 01 N 33/543 (2006.01)

G 01 N 33/566 (2006.01)

G 01 N 1/28 (2006.01)

G 01 N 33/547 (2006.01)

G 01 N 33/53 (2006.01)

【F I】

G 01 N 33/543 5 2 5 U

G 01 N 33/543 5 2 5 W

G 01 N 33/566

G 01 N 1/28 J

G 01 N 1/28 N

G 01 N 33/543 5 7 5

G 01 N 33/547

G 01 N 33/53 M

G 01 N 33/543 5 0 1 J

【誤訳訂正書】

【提出日】平成23年3月29日(2011.3.29)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】請求項1

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【請求項1】

- 基質の少なくとも1つの表面上に沈着させられる物質(化合物)を含有する霧状化される液体および操作中に液体上で発生する噴霧体を受容するための容器(液体容器)、

- 霧状化工程を誘発するための作動器、並びに

- コーティング工程中に基質を受容しそして貯蔵するための支持体

を含んでなる、親和性検定方法により1つもしくはそれ以上の分析試料を検出するための基質をコーティングする装置であって、基質が霧状化される液体の表面と接触しないことを特徴とする装置。